

別表（第4条、第5条関係）

区分	工程内容	単位	単価（税込、円）
			学内利用
登録料	－	1年	80,000
施設利用料	－	1件	設定なし
透過型電子顕微鏡用サンプル作製料	オスミウム固定→脱水→エポン樹脂包埋（自動包埋機使用もしくは手作業）→熱重合	1回	5,500
	準超薄切片作製	1断面	600
	超薄切片作製（通常：150グリッド2枚の場合）	1断面	1,200
	超薄切片作製（特注：単孔グリッド1枚の場合）	1断面	1,500
	超薄切片作製単孔グリッドの追加（特注：2枚目以降）	グリッド1枚	280
透過型電子顕微鏡用特殊サンプル作製料	ネガティブ染色（親水化处理→ウラン染色）by User	1回 （グリッド10枚まで）	800
	ネガティブ染色代行（親水化处理→ウラン染色）	グリッド1枚	1,400
走査型電子顕微鏡用サンプル作製料	オスミウム固定→脱水→t-ブチルアルコール置換→t-ブチルアルコール凍結乾燥→台載せ→金属コーティング	1回	4,300
	t-ブチルアルコール凍結乾燥→台載せ→金属コーティング	試料台1個	1,200
	走査型凸型試料台	試料台1個	960
	金属コーティング（白金・カーボン・オスミウム）	試料台1個	510
観察料	透過型電子顕微鏡および走査型電子顕微鏡 （9:30～12:30、13:30～16:30）	1回 （3時間）	2,500
FIB-SEMサンプル作製料	オスミウム固定→Block Stain→脱水→エポン樹脂包埋→熱重合	1回	5,700
	FIB-SEM台載せまで（準超薄切片作製→ウルトラトリムを用いてのトリミング→stubへの台載せ→銀ペースト→白金コーティング）	試料台1個	6,700
	stubへの台載せのみ（stubサイズ大）	試料台1個	250
	stubへの台載せのみ（stubサイズ小）	試料台1個	620
SEMアレイトモグラフィー法・SEM広視野連続（パノラマ）観察法サンプル作製料	オスミウム固定→脱水→エポン樹脂包埋→熱重合	1回	5,500
SEMアレイトモグラフィー法連続超薄切片作製料	シリコン基板の利用	1枚	6,900
	連続超薄切片作製（超薄切片100枚毎）	1回	9,900
SEM広視野連続（パノラマ）観察法超薄切片作製料	シリコン基板の利用	1/3枚	2,300
	超薄切片作製	1断面	1,100
SEMアレイトモグラフィー法・SEM広視野連続（パノラマ）観察法装置使用料	SEMアレイトモグラフィー法撮影条件の設定（超薄切片100枚毎）	1回	9,900
	SEM広視野連続（パノラマ）観察法撮影条件の設定	1サンプル	1,100
	SEM撮影	1時間	830
FIB-SEM装置使用料	serial section開始前の下準備（DEPO・Polish・Milling）を含む	1時間	2,100
画像解析ソフト使用料	24時間単位で1回とする	1回	1,800
画像解析サポート	画像解析のサポート（内容に関しては要個別相談）	1時間	2,200
クロスセクションポリッシャー（CP）	Ar ビームによる試料の加工	1回	980

1. 上記表中の単価は、単位あたりの利用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに単位数を乗じた金額を利用負担金とする。

2. 1時間未満の利用及び1時間を超える利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の利用として、利用負担金を算出するものとする。